

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2001年 2月28日

出願番号

Application Number:

特願2001-054182

[ST.10/C]:

[JP2001-054182]

出願人

Applicant(s):

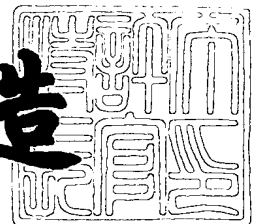
コニカ株式会社



2002年 1月11日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

及川耕造



出証番号 出証特2001-3115192

5081

【書類名】 特許願
 【整理番号】 DTM00548
 【あて先】 特許庁長官殿
 【国際特許分類】 G03B 27/58
 F16C 13/00

【発明者】

【住所又は居所】 東京都八王子市石川町 2 9 7 0 番地 コニカ株式会社内
 【氏名】 細江 秀

【特許出願人】

【識別番号】 000001270
 【住所又は居所】 東京都新宿区西新宿 1 丁目 2 6 番 2 号
 【氏名又は名称】 コニカ株式会社
 【代表者】 植松 富司

【代理人】

【識別番号】 100107272
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 田村 敬二郎

【選任した代理人】

【識別番号】 100109140
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 小林 研一

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 052526
 【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1
 【物件名】 図面 1
 【物件名】 要約書 1
 【包括委任状番号】 0101340

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 光学素子用金型、光学素子及びマスター型

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 光学素子を成形するための金型であって、過冷却液体域を有するアモルファス状合金を成形することによって形成された第 1 の型に対し、所定の面を削る加工を施すことによって形成された第 2 の型を含み、前記第 2 の型における前記加工された面は、前記光学素子の光学面もしくは寸法基準面を成形するために用いられることを特徴とする光学素子用金型。

【請求項 2】 前記第 1 の型は、過冷却液体領域を有するアモルファス状合金を加熱軟化しプレス成形することで形成されることを特徴とする請求項 1 に記載の光学素子用金型。

【請求項 3】 前記面を削る加工は、切削加工であることを特徴とする請求項 1 又は 2 に記載の光学素子用金型。

【請求項 4】 前記面を削る加工は、研削加工であることを特徴とする請求項 1 又は 2 に記載の光学素子用金型。

【請求項 5】 前記面を削る加工は、ダイヤモンド工具を用いて行うことを特徴とする請求項 3 又は 4 に記載の光学素子用金型。

【請求項 6】 光学素子を成形するための金型であって、過冷却液体域を有するアモルファス状合金を成形することによって形成された第 1 の型に対し、光学成形面に露光・現像処理を行って形成された第 2 の型を含み、前記第 2 の型における前記光学成形面は、前記光学素子の光学面を成形するために用いられることを特徴とする光学素子用金型。

【請求項 7】 光学素子を成形するための金型であって、過冷却液体域を有するアモルファス状合金を成形することによって形成された第 1 の型に対し、所定の面を削る加工を施し、露光・現像処理を施すことによって形成された第 2 の型を含み、前記第 2 の型における前記所定の面は、前記光学素子の光学面もしくは寸法基準面を成形するために用いられることを特徴とする光学素子用金型。

【請求項 8】 前記第 1 の型は、過冷却液体領域を有するアモルファス状合金を加熱軟化しプレス成形することで形成されることを特徴とする請求項 6 又は

7 に記載の光学素子用金型。

【請求項 9】 前記面を削る加工は、切削加工であることを特徴とする請求項 6 乃至 8 に記載の光学素子用金型。

【請求項 10】 前記面を削る加工は、研削加工であることを特徴とする請求項 6 乃至 8 に記載の光学素子用金型。

【請求項 11】 前記面を削る加工は、ダイヤモンド工具を用いて行うことを特徴とする請求項 9 又は 10 に記載の光学素子用金型。

【請求項 12】 前記光学素子の光学面に複数の突起又はくぼみが転写形成されるように、対応したくぼみ又は突起が形成されていることを特徴とする請求項 6 乃至 11 のいずれかに記載の光学素子用金型。

【請求項 13】 前記光学素子の光学面の突起又はくぼみは、等価屈折率領域の微細構造を形成することを特徴とする請求項 12 に記載の光学素子用金型。

【請求項 14】 前記光学素子の光学面の突起又はくぼみは、反射防止効果を発生する微細構造を形成することを特徴とする請求項 12 又は 13 に記載の光学素子用金型。

【請求項 15】 前記光学素子の光学面の突起又はくぼみは、構造複屈折を発生する微細構造を形成することを特徴とする請求項 12 乃至 14 のいずれかに記載の光学素子用金型。

【請求項 16】 前記光学素子の光学面の突起又はくぼみは、共鳴領域の微細構造を形成することを特徴とする請求項 12 乃至 15 のいずれかに記載の光学素子用金型。

【請求項 17】 前記光学素子の光学面の突起又はくぼみは、前記光学素子に対して光を照射する光源の波長変化による収差変化を調整する機能を有することを特徴とする請求項 12 に記載の光学素子用金型。

【請求項 18】 前記光学素子の光学面の突起又はくぼみは、温度変化による収差変化を調整する機能を有することを特徴とする請求項 12 又は 17 に記載の光学素子用金型。

【請求項 19】 前記光学素子の光学面の突起又はくぼみは、回折輪帯であることを特徴とする請求項 17 又は 18 に記載の光学素子用金型。

【請求項 2 0】 前記過冷却液体領域を有するアモルファス状合金が、室温で硬度 $H_v 300$ 以上であることを特徴とする請求項 1 乃至 1 9 のいずれかに記載の光学素子用金型。

【請求項 2 1】 前記過冷却液体領域を有するアモルファス状合金が、室温で硬度 $H_v 700$ 以下であることを特徴とする請求項 2 0 に記載の光学素子用金型。

【請求項 2 2】 前記過冷却液体領域を有するアモルファス状合金の組成に、パラジウムを $30 \text{ mol} \%$ 以上 $50 \text{ mol} \%$ 以下の割合で含むことを特徴とする請求項 1 乃至 2 1 のいずれかに記載の光学素子用金型。

【請求項 2 3】 前記過冷却液体領域を有するアモルファス状合金の組成に、銅、ニッケル、燐のいずれかを少なくとも $3 \text{ mol} \%$ 以上の割合で含有することを特徴とする請求項 1 乃至 2 2 のいずれかに記載の光学素子用金型。

【請求項 2 4】 前記過冷却液体領域を有するアモルファス状合金の組成に、ジルコニア、銅、アルミニウムのいずれかを少なくとも $3 \text{ mol} \%$ 以上の割合で含有することを特徴とする請求項 1 乃至 2 3 のいずれかに記載の光学素子用金型。

【請求項 2 5】 請求項 1 乃至 2 4 のいずれかに記載の光学素子成形金型を用いて成形したことを特徴とする光学素子。

【請求項 2 6】 前記光学素子は、プラスチック材料を素材とすることを特徴とする請求項 2 5 に記載の光学素子。

【請求項 2 7】 前記光学素子は、ガラス材料を素材とすることを特徴とする請求項 2 5 に記載の光学素子。

【請求項 2 8】 前記光学素子はレンズであることを特徴とする請求項 2 5 乃至 2 7 に記載の光学素子。

【請求項 2 9】 請求項 1 乃至 2 4 のいずれかに記載の光学素子成形金型を成形するためのマスター型。

【請求項 3 0】 500°C において硬度 $H_v 300$ 以上である材料により形成されていることを特徴とする請求項 2 9 に記載のマスター型。

【請求項 3 1】 前記マスター型の材料は石英であることを特徴とする請求

項 3 0 に記載のマスター型。

【請求項 3 2】 前記マスター型の材料は単結晶シリコンであることを特徴とする請求項 3 0 に記載のマスター型。

【請求項 3 3】 前記マスター型の材料はタングステンカーバイトを含んでいることを特徴とする請求項 3 0 に記載のマスター型。

【発明の詳細な説明】

【 0 0 0 1 】

【発明の属する技術分野】

本発明は、光学素子用成形金型、光学素子及びマスター型に関し、特に、所望の光学面を容易に形成でき、又寸法精度を向上させた光学素子用成形金型、光学素子及びマスター型に関する。

【 0 0 0 2 】

【従来技術】

従来から一般的に行われてきたプラスチック光学素子の光学素子用金型の製作手法は、鋼材やステンレス鋼などでブランク（一次加工品）を作っておき、その上に無電解ニッケルメッキとよばれる化学メッキにより、アモルファス状のニッケルと燐の合金を 1 0 0 μ m ほどの厚みに鍍膜し、このメッキ層を超精密加工機によりダイヤモンド工具で切削加工して、高精度な光学面を得ていた。

【 0 0 0 3 】

【発明が解決しようとする課題】

かかる従来技術の手法によれば、基本的に機械加工により部品形状を創成するため、加工機の運動精度近くまで容易に部品精度が高められる反面、製作工程に機械加工と化学処理が混在し煩雑で納期がかかること、メッキ層の厚みを考慮してブランク（一次加工品）を作製する必要があること、必ずしもメッキ処理が安定している訳ではなく、ブランクの組成の偏りや汚れ具合によってメッキ層の付着強度がばらついたり、ピットと呼ばれるピンホール状の欠陥が生じたりすること、メッキ層の厚みの中で光学面を創成しなければならないため、光学面を再加工するときなどはメッキ厚みに余裕が無く加工不可能となる場合があること、一般的には繰り返し使用はできず金型コストが高いこと等々の不具合が生じていた

【 0 0 0 4 】

また、多量に光学面を加工すると、工具の切れ刃の状態や加工条件、加工環境温度の変化などにより、微妙に切削加工し仕上げた光学面の形状がバラツいていた。この光学面加工バラツキは、一般的には100nm程度の光学面形状誤差を発生し、非常に慎重に加工した場合でも50nm程度の誤差が残り、これが加工精度限界であった。

【 0 0 0 5 】

また、近年、光学面に回折溝を施して色収差を効率よく補正する光学系が、光情報記録分野などで実用化され、大量に生産されている。光学材料としては、プラスチックやガラスが使われているが、赤外光学系などではZnSeなどの結晶材料も用いられている。この様な光学素子を大量に生産する時に効率の良い手法は、成形であるが、この際に成形金型の微細な回折溝を有する光学面を高精度に効率よく製作する技術が、極めて重要となっている。

【 0 0 0 6 】

例えば、ダイヤモンド切削により光学面上に回折溝などの光学機能を有する微細なパターンを創成する場合は、刃先の鋭さが回折溝形状の正確さを左右し、光学面として転写された時に回折効率に大きな影響を与えることが、特願2000-302748等で述べられるように知られている。

【 0 0 0 7 】

従って、回折輪帯の回折効率を低下させないためには、刃先の大きさを十分小さくせねばならず、そのため小さな刃先部分に切削抵抗が集中してかかるので切り込み量を小さくせねばならず、光学面全体を均一に切削除去するまでに加工回数が多くなる。また、小さなカッターマークによる光学面の表面粗さの劣化を防ぐためにも工具送り速度を遅くせねばならず、1回の光学面加工時間も長くなる。その結果、切削長が増大するので工具刃先の損耗が大きくなり、工具交換が頻繁となる。つまり、従来のダイヤモンド切削により微細な形状を有する光学面を加工する場合は、工具の寿命が極端に短くなり、また、切削によりダイヤモンド中のカーボンがブランクに拡散し、それにより工具の寿命を更に短縮化させるこ

ととなっている。しかも一つの光学面を加工する時間も増大するので、加工効率が非常に低下し、金型の生産性が低下してコストが急激に高くなっていた。そのため、特にダイヤモンド切削により微細な形状を表面に有する光学面を仕上げる場合には、無電解ニッケルメッキ工程を含まない簡素で納期の短い金型製作手法が望まれていた。

【0008】

加えて、近年、波長の数倍からそれよりも小さな微細構造を光学面に施して、新たな光学的機能を光学素子に付加することが試みられている。例えば、非球面光学面を有する成形レンズの表面に回折溝を施して、屈折による通常の集光機能とその時に副作用として発生する正の分散を、回折溝による回折の大きな負の分散を利用してうち消して、本来、屈折だけでは不可能な色消し機能を有する単玉光学素子が、DVD/CD互換の光ディスク用ピックアップ対物レンズで実用化されている。これは、光学素子を透過する光の波長の数10倍の大きさの回折溝による回折作用を利用したもので、このように波長より十分大きな構造による回折作用を扱う領域は、スカラー領域と呼ばれている。

【0009】

一方、光学素子を透過する光の波長の数分の一という微細な間隔で、円錐形状の突起を光学面の表面に密集させて形成させることで、光の反射抑制機能を発揮させることができることが判っている。即ち、微細な間隔で突起を形成することで、光波が光学素子に入射する際の空気界面での屈折率変化を、従来の光学素子のように1から媒体屈折率まで瞬間的に変化させるのではなく緩やかに変化させ、それにより光の反射を抑制することができるのである。このような突起を形成した面は、いわゆる蛾の眼 (moth eye) と呼ばれる微細構造で、光の波長よりも微細な構造体が波長よりも短い周期で並ぶことにより、もはや個々の構造が回折せず光波に対して平均的な屈折率として働くもので、このような領域を等価屈折率領域と一般に呼んでいる。このような等価屈折率領域に関しては、例えば電子情報通信学会論文誌 C Vol. J83-C No. 3 pp. 173-181 2000年3月に述べられている。

【0010】

このような等価屈折率領域の微細構造によれば、従来の反射防止コートに比べて反射防止効果の角度依存性や波長依存性を少なくしながら同時に大きな反射防止効果を得ることができ、また、成形により光学面と微細構造が同時に創成できることから、レンズ機能と反射防止機能が同時に得られて、従来のように成形後にコート処理をするといった後加工が不要となる、など生産上のメリットも大きいと考えられ注目されている。さらに、このような等価屈折率領域の微細構造を光学面に対して方向性を持つように配すると、強い光学異方性を光学面に持たせることもでき、従来、水晶などの結晶を削りだして製作していた複屈折光学素子を成形によって得ることができ、また、屈折や反射光学素子と組み合わせて新たな光学的機能を付加することができる。この場合の光学異方性は、構造複屈折と呼ばれている。

【 0 0 1 1 】

上述したスカラー領域と等価屈折率領域の間には、回折効率が入射条件のわずかな違いにより急激に変化する共鳴領域がある。例えば、回折溝幅を狭くしていくと、波長の数倍程度で急激に回折効率が減少し、また増加するという現象（アノマリー）が発生する。特定の波長のみを反射する導波モード共鳴格子フィルターとして、通常の干渉フィルターと同等の効果をより角度依存性を少なくして実現できている。

【 0 0 1 2 】

ところで、スカラー領域や、等価屈折率領域や、共鳴領域を利用して光学素子を形成しようとする場合、その光学面に微細な突起（又はくぼみ）を形成する必要がある。このような微細な突起（又はくぼみ）を備えた光学素子を大量生産するには、一般的にはプラスチックを素材として成形を行うことが適しているといえるが、かかる場合、微細な突起（又はくぼみ）に対応したくぼみ（又は突起）を備えた成形面を、型に設ける必要がある。

【 0 0 1 3 】

しかるに、上述したような等価屈折率領域や共鳴領域の突起（又はくぼみ）に関しては、数十乃至数百ナノメートルの間隔で突起（又はくぼみ）を形成しなくてはならず、切削加工を含む機械的加工では極めて困難である。加えて、従来の型

は再利用が困難という問題もある。

【 0 0 1 4 】

本発明は、かかる従来技術の問題点に鑑みてなされたものであり、従来とは全く異なる思想に基づいて、切削性に優れ、寸法精度を高めることができ、しかも所望の光学面の形状を転写形成可能な光学素子成形金型を提供することを目的とする。又、本発明は、微細形状を転写形成可能な光学素子成形金型、それを用いて形成される光学素子及びマスター型を提供することを目的とする。

【 0 0 1 5 】

請求項 1 の光学素子用金型は、光学素子を成形するための金型であって、過冷却液体域を有するアモルファス状合金を成形することによって形成された第 1 の型に対し、所定の面を削る加工を施すことによって形成された第 2 の型を含み、前記第 2 の型における前記加工された面は、前記光学素子の光学面もしくは寸法基準面を成形するために用いられるので、前記アモルファス状合金の被削性が極めて良好であることから、前記所定面として、前記光学素子の光学面もしくは寸法基準面に対応する金型の成形面を精度良く仕上げることができ、しかも工具の寿命を延長させることができる。尚、寸法基準面とは、例えば光学素子のフランジ部周面などのごとく、その光学素子を他の部材に取り付ける際に、位置決め基準となるような面をいう。

【 0 0 1 6 】

ここで、過冷却液体域を有するアモルファス状合金について説明する。近年、金属ガラスと呼ばれる、加熱すると過冷却液体となるアモルファス状の合金材料が注目されている。これは、通常の金属が多結晶組成であるのに対して、組織がアモルファス状のため組成がミクロ的にも均一で機械強度や常温化学耐性に優れ、ガラス転移点を有し、ガラス転移点 + 5 0 ~ 2 0 0 ℃ 前後（これを過冷却液体域という）に加熱するとガラス状に軟化するためプレス成形加工が出来るという、通常の金属に無い特徴を有する。

【 0 0 1 7 】

従来、金属ガラスについてこの加熱プレス成形によって成形金型を創成する技術が特開平 1 0 - 2 1 7 2 5 7 号公報で述べられ、また稜線を有する光学素子に

ついて特開平9-286627号公報で述べられている。また、日本機械学会65巻633号346-352「金属ガラスの精密・微細加工に関する研究」で、金属ガラスをプレス成形して光学面を有する成形金型部品を創成した例が述べられている。この例では、プレス成形による転写光学面の形状精度は500nm、表面粗さは90nmとしている。

【0018】

ここで、本発明者は金属ガラスのアモルファス構造に着目し、金属ガラスに対し直接ダイヤモンド工具による超精密切削加工を行うと、高精度な光学鏡面が容易に得られることを新たに見いだした。その理由は、この材料がアモルファス状であり結晶粒界を持たないので場所によらず被削性が均一であること、又アモルファス状を保つために結晶化エネルギーを大きくして組成的に多晶体としているため、切削加工中のダイヤモンドの拡散摩耗が少なく工具の刃先寿命を長く保てること等によるものであることがわかった。同様なことは、ダイヤモンド工具などを用いた研削加工にもいえる。

【0019】

特に、本発明を適用した例では、従来の加熱プレス成形のみによる成形金型や光学面素子の光学面創成を行うのではなく、まず金属ガラスを加熱プレス成形によりニアネットシェイプ、即ち仕上げ形状に非常に近いブランク（第1の型）を製作した後、超精密加工機によるダイヤモンド切削で、光学素子の光学面やその他の嵌合面に対応する面などを切削加工して、第2の型に仕上げるというものである。

【0020】

このような手法で成形する際は、割り型を用いてパーティングラインが、成形した光学素子の光学面に残るように成形しても良く、また抜き勾配があっても良い。切削加工などの後加工によって、容易に削除できるからである。又、加熱プレス成形等により形成した第1の型に、基準となる面を加工創成した後、この面を基準として偏心が最小となるよう加工機に取り付け、光学面に対応する面（光学成形面という）を超精密加工機によりダイヤモンド切削加工すれば、偏心の少ない高精度な光学成形面を容易に創成できる。この手法によると、第1の型の寸

法精度は、最終仕上げ寸法に対して $5 \sim 10 \mu\text{m}$ 程大きく成形すれば良く、後加工による加工取り代が従来の約 $1/10$ 以下となる。従って、本発明による光学素子用金型は、極めて効率よく大量に製作することができるといえる。

【0021】

また、本発明の光学素子用金型は、従来の金型のような化学メッキ処理が全く不要であり、メッキ厚を、ブランク寸法を決めるのに考慮する必要もないため、光学成形面加工に至るまでのブランク製作工程が極めて簡素になり、納期も従来の $1/4$ 以下とすることができる。さらに、何度でも光学成形面を再切削加工でき、不要となった場合でも、加熱プレス成形により別の形状の型材料とすることが出来るので、材料寿命としては半永久的となる。

【0022】

一方、本発明を別な角度で見ると、以下のようなことも考えられる。本発明者は、金属ガラスがプラスチックなどの成形と根本的に異なる点として、金属材料であるから熱伝導性が非常に高く全体が瞬間的に固化し、冷却収縮が小さくしかも成形部位によらず比例的に発生することや型との反応性が低いことなどから、成形圧力や成形時間を最適化することによりプラスチック成形で得られる光学面と同等またはさらに高精度に再現性良く転写できることに思い至った。

【0023】

そこで、光学面上に微細な突起（又はくぼみ）を有する光学素子の成形金型として、何らかのマスターから成形転写することで、かかるアモルファス状合金製の光学素子用金型を得れば、最終成形品であるプラスチックなどの光学素子よりも形状精度の高い金型を多量に容易に得ることが実現できる。そのようにして形成された精度の高い光学成形面を有する第1の型に対して、成形時に生じたパーティングラインなどを機械加工で除去すれば、高精度な光学素子用金型を得ることができるのである。尚、光学素子成形用金型を成形するのに必要なマスターは、光学素子の光学面に対応する面にレジストをスピコート法などで塗布し、電子ビームやレーザービームによって微細パターンを露光した後、現像によって光学面上の微細パターンを形状化することにより得ることができる。

【0024】

すなわち、本発明の光学素子用金型は、従来の光学面の加工時間に比べて3倍以上を有する微細な形状を有する光学成形面などの加工において、ニアネットシェイプである第1の型を容易に製作でき、光学成形面の切削回数を大幅に低減して加工効率を向上できる。但し、本発明の範囲は、微細な光学パターンに依存しない。また、使用されるダイヤモンド工具形状や切削条件にも依存しない。本発明は、金属ガラスの一例であるアモルファス状合金がダイヤモンド切削により高精度な光学面を得られるという、新たに発明者が発見した知見に基づき、成形により得られた第1の型に対して、ダイヤモンド切削による光学成形面の創成や基準面の創成を行って第2の型を形成するという高精度な光学素子用金型を範疇とするものである。

【0025】

本発明の光学素子用金型で用いることができるアモルファス状合金の種類は問わない。Pd系、Mg系、Ti系、Fe系、Zr系などの公知の金属ガラスが使えるが、過冷却液体領域を有するアモルファス状である金属材料であることが、本発明に必要な要件であって、これらの組成や種類は問わない。ただし、プラスチック光学素子成形用の金型材料としては、樹脂温度が300℃近くであることから、Pd系、Ti系、Fe系などがガラス転移点が高いので有利であるが、より好ましくはPd系が空気中でほとんど酸化することなく、加熱プレスができ、また、大きなバルク形状が出来るという点でも有利である。この場合、主成分であるPdは貴金属で高価ではあるが、本発明の方法で製作された金属ガラスの成形金型は不要となれば鑄潰して再利用できるため、短納期で加工労務費が低いことを合わせると、長期にわたる金型コストは従来金型より低コストにできる。

【0026】

請求項2に記載の光学素子用金型は、前記第1の型は、過冷却液体領域を有するアモルファス状合金を加熱軟化しプレス成形することで形成されるため、たとえ仕上げ形状が複雑な形状であっても、それに非常に近いニアネットシェイプを容易に形成することができる。

【0027】

請求項3に記載の光学素子用金型は、前記面を削る加工は、切削加工であると

、精度の良い加工ができる。

【0028】

請求項4に記載の光学素子用金型は、前記面を削る加工は、研削加工であると、精度の良い加工ができる。

【0029】

請求項5に記載の光学素子用金型は、前記面を削る加工は、ダイヤモンド工具を用いて行くと、その寿命を大幅に延長することができる。

【0030】

請求項6に記載の光学素子用金型は、光学素子を成形するための金型であって、過冷却液体域を有するアモルファス状合金を成形することによって形成された第1の型に対し、光学成形面に露光・現像処理を行って形成された第2の型を含み、前記第2の型における前記光学成形面は、前記光学素子の光学面を成形するために用いられるので、切削加工などでは不可能な、例えば微細なくぼみ（又は突起）を前記処理によって面に形成することができ、それにより成形された光学素子の光学面微細な突起（又はくぼみ）を形成することで、多機能な光学素子を成形することができる。

【0031】

さらに、回折光学素子などの微細な形状を有する光学面を、直接金型の光学成形面上に創成する手法を、本発明者は考案した。その例を示すと、非球面形状など加工した第1の型の光学成形面上に、スピコートなどで0.1～3 μ mの厚みにレジストを直接塗布して、これに電子ビームやレーザービームなどで直接描画して現像し、レジストの微細光学パターンを光学表面に形成した後、ドライエッチングにより光学形成面表面に回折溝に対応する突起又はくぼみなどの微細な形状を形成し、成形金型を得るものである。

【0032】

金属ガラスは前述したように、アモルファス状であり全体が均一で結晶粒界を持たないため、どの部位であっても全く単一組成の方向性を持たない材料である。つまりこれは、ドライエッチングにおいて例えば単結晶シリコンのように結晶方位で選択的にエッチングが進行するということがなく、条件に従ってエッチン

グが均一に進むということである。従ってアモルファス状合金の表面にレジストの厚みで微細光学パターンを形成して、イオンや電離したガス成分などを一方向から加速してレジスト表面に照射すると、その厚みにほぼ比例して照射方向にエッチングが進行する。アモルファス状合金は導体であるから、電子ビームによる露光やイオンエッチングなどで荷電粒子を加速して表面にぶつける際に容易に電界を形成できるので、石英基材などのようにレジスト表面に導電膜を施す工程は全く不要で、具合が良い。

【 0 0 3 3 】

また、このような荷電粒子によるエッチングは、ダイヤモンドなどの先端を鋭利に加工する用途として既に実用化されており、装置も希ガスなどを電離してイオン化し電界をかけて加速してぶつける非常に単純な構造であるため、本発明を実現するために特別な設備を開発する必要はない。本発明では、露光・現像処理の例としてのドライエッチングに用いる荷電粒子の種類は問わない。アモルファス状合金を用いた成形金型の光学成形面上に、レジストで形成した微細形状を荷電粒子を照射することでドライエッチングして、高精度な微細構造光学素子用金型を得ることも本発明の範疇である。

【 0 0 3 4 】

この第 1 の型となるアモルファス状合金に直接レジストを塗布してドライエッチングする手法は、金型の必要数量が多くないときに有効である。但し、マスター型に形成した微細な形状の光学パターンを加熱プレス成形で転写して、アモルファス状合金の成形金型を得る手法は、多量に金型を必要とするときに有効である。

【 0 0 3 5 】

ここで、前記第 1 の型の露光・現像処理についてより具体的に説明する。半導体素子などを形成する手法として、シリコンウェハーにフォトリソ（レジストともいう）を塗布し、レーザビームを照射して所定のパターンを描画する手法が知られている。これを利用して、前記第 1 の型に微細なくぼみ（又は突起）を形成することが考えられる。

【 0 0 3 6 】

即ち、第1の型における非球面などの光学成形面においても、全く同様にフォトリジストをスピンコート法などで塗布し、電子ビームやレーザービームによって微細パターンを露光した後、現像によって光学面上のくぼみ（又は突起）などの微細パターンを形状化するのである。

【0037】

この手法によれば、上述した微細なくぼみ（又は突起）以外にも、通常の機械加工での創成では極めて困難である、非対称や非軸対称なパターンや形状を含んだ微細な形状を、光学成形面上に、露光ビームの制御だけでより高精度に創成することが可能となる。

【0038】

尚、フォトリジストの厚みは通常1 μm 程度であるが、塗布乾燥後ポストベーキングして十分固化させた後、再塗布をすることによりフォトリジストを厚くすることができる。露光手法は、電子ビームやレーザービームなどの露光量（ドーズ量）を調整することにより、ネガ型のレジストでは露光量の多いところはより固化して現像の際に残り、ポジ型では逆に現像液中に溶出するので、露光量によって現像の進行に差が生じ、それによりレジストの立体的な微細形状が創成できる。

【0039】

レジストは樹脂であるから、このまま金型の成形転写面として用いるには強度や密着性が不足し実用にならない。従って、何らかの手法によって、このレジストによる光学面上の微細な形状をマスターとして金型材料に転写する必要がある。従来、この手法の一つとして電鍍が使われていた。例えば、光ディスクのピットパターンを転写してスタンパ金型を製作する際に、レジストによりガラス基板上に創成されたピットと呼ばれる光記録パターン表面を、銅などのフラッシュメッキで表面に導電性を持たせた後、電解液中で電界をかけて金属ニッケルを析出附着させることで、微細な形状を写し取るものである。

【0040】

しかしながら、電鍍はその生成方法から容易に想像できるように、析出して突出したところほど電界密度が増し、さらにメッキが進むという現象が起き、その

ためメッキ液中の電界分布はミクロ的に常に変動しており均一に電鍍の厚みが増えるわけではない。そのため、電鍍内には非常に大きな応力が発生するので、表面の微細形状は精度良く転写できるが、基盤の平面形状は応力でマスターから剥離した段階で反ったりするのが普通である。前述した光ディスク基板のように、全体が平面形状の場合は、電鍍の厚みを0.1mm以下に非常に薄くすることと、マスターから剥離後に裏面を薄く研磨して平面性を確保するなどの後工程を行い、金型の平面部に倣うように取り付けることで、金型内で平面形状を維持している。

【0041】

これに対し、基板形状が非球面光学面などのように高精度な立体形状の場合は、このような従来の手法は使えず、電鍍処理後にマスターから剥離した瞬間に、光学面形状は歪んでしまうという問題がある。電鍍の状態にもよるが、数mmの厚みに電鍍を施した場合は、10 μ m程度は歪みによる光学面の変形を考慮する必要がある。世の中では、微細な形状を有する光学面の形状精度は少なくとも100nm以下、高精度な用途では50nm以下が要求されており、従ってこのように高精度な光学面を電鍍により転写してレジストから金型を得ることはできない。従って、従来のレジストによる微細な形状を表面に有する光学面は、電鍍により転写しても微細な形状は写し取れるが、光学面形状は歪んで使用できなかったのである。

【0042】

そこで、本発明においては、まず、光学素子の光学面の、例えば非球面形状に精度良く一致させた光学成形面を備えたニアネットシェイプの第1の型を成形し、更にその光学成形面に対して、スピンコート法でレジストを塗布した後、電子ビームやレーザビームで所定のパターンを形成し、その後ドライエッチングを施すことで、例えば微細なくぼみ（又は突起）が形成されるようにしている。以上の処理が、現像・露光処理の一例であるが、これに限られない。ドライエッチングとしては、ガスエッチングによる化学的なエッチングやイオンエッチング、プラズマエッチングなどの物理的なエッチングとそれらを複合したエッチング技術がある。また、微細な形状の創成に基板材料のエッチング異方性を積極的に利用

する技術もある。

【 0 0 4 3 】

請求項 7 に記載の光学素子用金型は、光学素子を成形するための金型であって、過冷却液体域を有するアモルファス状合金を成形することによって形成された第 1 の型に対し、所定の面を削る加工を施し、露光・現像処理を施すことによって形成された第 2 の型を含み、前記第 2 の型における前記所定の面は、前記光学素子の光学面もしくは寸法基準面を成形するために用いられるので、請求項 1 又は 6 の発明の光学素子用金型に対し、より精度の高い或いは所望のパターンを形成した光学成形面などの形成が可能となっている。尚、例えば前記第 1 の型において、前記光学素子の光学面に対応する光学成形面が精度よく形成されていない場合に、切削加工などによって、所定の面としての前記光学成形面を切削することで仕上げ加工を施すことも、また前記第 1 の型において、前記光学素子の光学面に対応する光学成形面が精度よく形成されている場合に、所定の面としての前記光学成形面に更に露光・現像処理（或いは切削加工）を施すことで、微細な突起を形成することも、本発明の範疇に含まれる。同様なことは、寸法基準面に対応する型の面にもいえる。

【 0 0 4 4 】

請求項 8 に記載の光学素子用金型は、前記第 1 の型は、過冷却液体領域を有するアモルファス状合金を加熱軟化しプレス成形することで形成されるため、たとえ仕上げ形状が複雑な形状であっても、それに非常に近いニアネットシェイプを容易に形成することができる。

【 0 0 4 5 】

請求項 9 に記載の光学素子用金型は、前記面を削る加工は、切削加工であると、精度の良い加工ができる。

【 0 0 4 6 】

請求項 1 0 に記載の光学素子用金型は、前記面を削る加工は、研削加工であると、精度の良い加工ができる。

【 0 0 4 7 】

請求項 1 1 に記載の光学素子用金型は、前記面を削る加工は、ダイヤモンド工

具を用いて行くと、その寿命を大幅に延長することができる。

【 0 0 4 8 】

請求項 1 2 に記載の光学素子用金型は、前記光学素子の光学面に複数の突起又はくぼみが転写形成されるように、対応したくぼみ又は突起が形成されていると、例えば間隔が数十乃至数百ナノメートルという微細な突起又はくぼみであっても、前記光学面に転写成形できるので、多機能な光学素子を得ることができる。

【 0 0 4 9 】

請求項 1 3 に記載の光学素子用金型は、前記光学素子の光学面の突起又はくぼみが、等価屈折率領域の微細構造を形成するものであるもので、前記光学素子の光透過率をより高めることができる。尚、前記突起又はくぼみの間隔は、前記光学素子の光学面を透過する光の波長以下であると好ましい。

【 0 0 5 0 】

請求項 1 4 に記載の光学素子用金型は、前記光学素子の光学面の突起又はくぼみが、反射防止効果を発生する微細構造を形成するものであるもので、前記光学素子の光透過率をより高めることができる。尚、前記突起又はくぼみの間隔は、前記光学素子の光学面を透過する光の波長以下であると好ましい。

【 0 0 5 1 】

請求項 1 5 に記載の光学素子用金型は、前記光学素子の光学面の突起又はくぼみが、構造複屈折を発生する微細構造を形成するものであるもので、例えば、前記光学素子の光透過率を光の振動方向に対して変化させることができる。尚、前記突起又はくぼみの間隔は、前記光学素子の光学面を透過する光の波長以下であると好ましい。

【 0 0 5 2 】

請求項 1 6 に記載の光学素子用金型は、前記光学素子の光学面の突起又はくぼみが、共鳴領域の微細構造を形成するものであるもので、例えば前記光学素子の収差の度合いを変化させて、異なる機能を発揮させることができる。

【 0 0 5 3 】

請求項 1 7 に記載の光学素子用金型は、前記光学素子の光学面の突起又はくぼみが、前記光学素子に対して光を照射する光源の波長変化による収差変化を調整

する機能を有するものであるので、前記光学素子の機能をより高めることができる。

【 0 0 5 4 】

請求項 1 8 に記載の光学素子用金型は、前記光学素子の光学面の突起又はくぼみが、温度変化による収差変化を調整する機能を有するので、前記光学素子の機能をより高めることができる。

【 0 0 5 5 】

請求項 1 9 に記載の光学素子用金型は、前記光学素子の光学面の突起又はくぼみが、回折輪帯であるので、例えば第 1 の型の段階で回折輪帯を形成すれば、従来、回折輪帯を形成するために用いていた切削加工が不要となり、加工にかかる手間及びコストを削減することができる。

【 0 0 5 6 】

請求項 2 0 に記載の光学素子用金型は、前記過冷却液体領域を有するアモルファス状合金が、室温で硬度 $H_v 300$ 以上であると好ましい。

【 0 0 5 7 】

請求項 2 1 に記載の光学素子用金型は、前記過冷却液体領域を有するアモルファス状合金が、室温で硬度 $H_v 700$ 以下であると好ましい。

【 0 0 5 8 】

通常、金型材料の硬度は、ダイセット金型との摺動や光学成形面の清掃などによる摩耗や傷の発生など、実使用上の耐久性を満足する程度に高いことが要求され、従って $H_v 300$ 以上は必要である。しかし、あまり硬度が高いと光学面のダイヤモンド切削時に工具の負担が大きくなり、工具寿命を縮めたり高精度の光学成形面形状の創成が難しくなるので、同時に $H_v 700$ 以下であることが好ましい。金属ガラスであるアモルファス状合金の硬度は、一般的には、室温で、従来の無電界ニッケルメッキとほぼ同等の $H_v 500 \sim 600$ であり、引っ張り強度は従来のブランク鋼材に対して 2 倍ほど高く、機械強度の点でも申し分なく、従来より丈夫な金型材料であるといえる。さらに、化学耐性が高いので、プラスチック成形時に発生する微量の腐食性ガスなどにも安定で、成形中に光学成形面に曇りが発生することも防止できる。

【 0 0 5 9 】

請求項 2 2 に記載の光学素子用金型は、前記過冷却液体領域を有するアモルファス状合金の組成に、パラジウムを 3 0 m o l % 以上 5 0 m o l % 以下の割合で含むと、光学素子用金型に好適な非晶質合金を得ることができる。

【 0 0 6 0 】

請求項 2 3 に記載の光学素子用金型は、前記過冷却液体領域を有するアモルファス状合金の組成に、銅、ニッケル、燐のいずれかを少なくとも 3 m o l % 以上の割合で含有するので、光学素子用金型に好適な非晶質合金を得ることができる。

【 0 0 6 1 】

請求項 2 4 に記載の光学素子用金型は、前記過冷却液体領域を有するアモルファス状合金の組成に、ジルコニア、銅、アルミニウムのいずれかを少なくとも 3 m o l % 以上の割合で含有するので、光学素子用金型に好適な非晶質合金を得ることができる。

【 0 0 6 2 】

請求項 2 5 に記載の光学素子用金型は、請求項 1 乃至 2 4 のいずれかに記載の光学素子成形金型を用いて成形してなるので、高精度又は多機能な光学素子となる。

【 0 0 6 3 】

請求項 2 6 に記載の前記光学素子は、プラスチック材料を素材とするので、例えば光学成形面の微細な形状を精度良く転写できる。

【 0 0 6 4 】

請求項 2 7 に記載の前記光学素子は、ガラス材料を素材とするので、例えば光学成形面の微細な形状を精度良く転写できる。

【 0 0 6 5 】

請求項 2 8 に記載の前記光学素子はレンズであると、機械加工では大量生産が困難な非球面光学面などを転写により容易に成形できる。

【 0 0 6 6 】

請求項 2 9 に記載のマスター型は、請求項 1 乃至 2 4 のいずれかに記載の光学

素子成形金型を成形することを特徴とする。

【 0 0 6 7 】

請求項 3 0 に記載のマスター型は、5 0 0 ℃において硬度 H v 3 0 0 以上である材料により形成されていれば、加熱され軟化したアモルファス状合金を成形することができる。

【 0 0 6 8 】

請求項 3 1 に記載のマスター型は、その材料は石英であると、請求項 3 0 に述べた特性を有し、又化学的安定性に優れるので好ましい。

【 0 0 6 9 】

請求項 3 2 に記載のマスター型は、その材料は単結晶シリコンであると、請求項 3 0 に述べた特性を有し、又化学的安定性に優れるので好ましい。

【 0 0 7 0 】

請求項 3 3 に記載のマスター型は、前記マスター型の材料はタングステンカーバイトを含んでいれば、粉末冶金から形成でき、又加熱され軟化したアモルファス状合金を形成することができる。

【 0 0 7 1 】

本明細書中で用いる回折溝とは、光学部材（例えばレンズ）の表面に、レリーフを設けて、回折によって光束を集光あるいは発散させる作用を持たせた溝のことをいう。レリーフの形状としては、例えば、レンズの表面に、光軸を中心とする略同心円状の輪帯として形成され、光軸を含む平面でその断面をみれば各輪帯は鋸歯のような形状が知られているが、そのような形状を含むものである。

【 0 0 7 2 】

本発明が適用されるに当たり、突起（又はくぼみ）の並びなど、個々の微細構造の形状や配列周期などは関係ない。どのような微細な構造であっても、光学素子に新たな機能を付加する目的で作られたものであれば、その成形金型は本発明の範疇に含まれる。また、新たに付加する機能としては、収差を低減するものに限らない。光学系の特性に応じて収差を故意に増加させる場合も、最終的に理想とする収差に近づける目的で行う限り、本発明の範疇に含まれる。

【 0 0 7 3 】

【発明の実施の形態】

以下、図面を参照して、本発明の実施の形態について説明する。図1は、光学素子用金型を製作する工程を示す図である。まず、図1(a)に示すように、光学素子の一例であるレンズの非球面に対応した母非球面1aを形成したマスター型材1に、支柱5を取り付け、且つ円筒状のブランク型2を組み付ける。更に、図1(b)に示すように、マスター型材1及びブランク型2をヒーターHにより予備加熱しておき、過冷却液体域間で加熱し軟化させたアモルファス状合金MGを、急激な固化を抑制しつつブランク型2内に挿入し、プランジャー6で加圧する。このときブランク型2内の空気は、エアベント（ブランク型2の端面に形成された溝2a）を介して外部へと流出する。アモルファス状合金MGは、溶融した樹脂と同様に柔軟性があるため、わずかな加圧であっても、ブランク型2の内形状に一致するように変形し、又、マスター型材1の母光学面1aの形状に一致するように変形する。すなわち、マスター型材1の光学面1aに対応する光学面成形面（後述する10a）は、非球面形状に形成されることとなる。アモルファス状合金MGを軟化させて成形することで、マスター型4の損耗を抑制し、その寿命を延長することができる。

【0074】

更に、図1(c)に示すように、マスター型4とプランジャー6とを一体で、冷却水が満たされた容器7内に沈下させることで、アモルファス状合金MGを急冷させる。尚、かかる冷却は自然放冷であっても良い。その後、容器7から取り出したマスター型4とプランジャー6とを分離させ、固化したアモルファス合金MGを取り出すことで、第1の型10（図2）が形成される。尚、成形後のアモルファス状合金のフランジ外周面の仕上げ加工において、マスター型材1のティルト基準面（図4の10bに対応）でティルトを合わせた後、光学成形面10aを回転させて、その偏心量に基づいて調整を行うことで、光学成形面10aの偏心量の除去を機械加工で行える。

【0075】

図2は、第1の型10を機械加工する状態を示す図である。図2において、第1の型10を不図示の駆動体で回転させながら、ダイヤモンド工具Tで、光学成

形面 1 0 a を切削加工し、第 2 の型即ち光学素子用金型 1 0' を形成している。
 このような切削加工により、例えば光学成形面 1 0 a に、最終製品であるレンズの回折輪帯に対応する溝を形成することができる。又、パーティングラインの削除や、偏心調整などを行うためのフランジ周面の加工も可能である。切削加工に限らず、ダイヤモンド砥石を用いた研削加工であっても良い。

【 0 0 7 6 】

図 3 は、光学素子であるレンズを成形するための金型を示す断面図である。上述のようにしてアモルファス状合金 M G から形成し機械加工を施した光学素子用金型 1 0' と、同様に形成した光学素子用金型 1 1 とを、それぞれ光学面成形面 1 0 a、1 1 a 同士を対向させるようにして、ダイセット金型 1 2、1 3 に挿入し、溶融したプラスチック材料 P L を光学素子用金型 1 0'、1 1 間に射出し、更に冷却することで、所望の形状のレンズを得ることができる。

【 0 0 7 7 】

更に、本発明の第 2 の実施の形態に関して説明する。図 4 は、アモルファス状合金から成形された第 1 の型 1 0 に露光・現像処理工程を示す図である。予め、第 1 の型 1 0 の光学成形面 1 0 a は、図 2 に示すような成形工程で、マスター型材から非球面形状を精度良く転写されているものとする（図 4（a））。

【 0 0 7 8 】

続いて、図 4（b）に示すように、不図示の駆動体によって第 1 の型 1 0 を光軸回りに回転させながら、光学成形面 1 0 a にレジスト R を塗布する（スピコート）。レジスト R は、光学成形面 1 0 a を含むマスター型材 1 の上面 1 0 b に、等しい膜厚でコーティングされる。

【 0 0 7 9 】

更に、図 4（c）に示すように、レジスト R がコーティングされた光学成形面 1 0 a に対し、不図示の露光機により電子ビーム L B を照射して、微細パターンを露光形成する。電子ビーム L B のビーム径は極めて小さいため、数十乃至数百ナノメートルの間隔で、レジスト R を除去することができる。

【 0 0 8 0 】

その後、図 4（d）に示すように、部分的にレジスト R が除去された第 1 の型

10の上面を、イオンシャワーIS（加速されたアルゴンイオン等）の雰囲気中に曝し（ドライエッチング）、レジストRのパターンに応じて、第1の型10の表面を除去する。このとき、レジストRの残っている部分は、表面が除去されないため、露光時に多数の微細な円形状でレジストRを除去することで、第1の型10の光学形成面10aの表面に、小さな円筒形状のくぼみが多数形成され、第1の型即ち光学素子用金型10'を形成できることとなる。又、電子ビームの露光量（ドーズ量）を調整すれば、円錐状のくぼみや、鋸歯状の輪帯に対応したくぼみなどを任意に形成することができる。

【0081】

このようにして形成された光学素子用金型10'を用いて、図3に示すように光学素子（レンズ）を形成することが可能となる。尚、図4に示すようにして形成された第2の型10'に対して、更に図2に示すような切削加工を施すことも可能であり、或いは図2に示す切削加工の後に、図4に示すような露光・現像処理を行っても良い。

【0082】

図5は、このような光学素子用金型により形成されるレンズの光学面を拡大して示す一部断面斜視図である。図5（a）においては、レンズの光学面に、複数の突起の例として微細な円筒Cをマトリクス状に多数形成した構成（等価屈折率領域の微細構造の例）となっている。例えばかかるレンズをDVD記録／再生用光ピックアップ装置の対物レンズとして用いた場合、レンズを透過する光は650nm近傍である。そこで、微細な円筒Cの間隔 Δ を160nmとすると、かかる対物レンズに入射する光は殆ど反射せず、極めて光透過率の高いレンズを提供することができる。

【0083】

図5（b）においては、レンズの光学面に、複数の突起の例として間隔 Δ で離隔した多数の微細な三角錐Tを形成しており、図5（a）と同様な更に顕著な効果を有する。図5（c）においては、レンズの光学面に、複数の突起の例として間隔 Δ で離隔した多数のフィンF（構造複屈折の微細構造の例）を形成している。フィンFの長さは、透過する光の波長より長く（上述の例では650nm以上

）になっている。かかる構成を備えたレンズは、フィンFに沿った方向に振動面を有する光を透過させるが、フィンFに交差する方向の光は透過させないという、いわゆる偏光効果を奏する。図5（d）においては、レンズの光学面に、連続した複数の突起の例として回折輪帯Dを形成している。回折輪帯Dに関しては、例えば特願2000-13071に、その形状に応じた効果である色収差補正及び温度補正について詳細に述べられているので、以下の説明を省略する。

【0084】

以下に述べる実施例では、金属ガラスは過冷却液体域を有するアモルファス合金である。

（実施例1）

直径7mmで長さ35mmの円筒状の端面に非球面の光学成形面を有するレンズ成形用金型10本を、従来の化学メッキを施して製作したものと、本発明による第1の型成形後に、加工仕上げするものとの比較を行った。前者は、50 μ m小さめの第1の型を通常旋盤で切削した後、無電界ニッケルメッキを100 μ m施し、外周と光学成形面を超精密旋盤によるダイヤモンド切削で50 μ m削り落として規定寸法に仕上げ第2の型を得た。この時要した時間は、第1の型加工で2時間、無電界ニッケルメッキに20時間、ダイヤモンド切削加工に10時間で、合計32時間であった。一方、本発明による金型は、汎用旋盤でマスター型を作り、金属ガラス材料 $Pd_{40}Ni_{10}Cu_{30}P_{20}$ を空気中で加熱軟化してプレス成形して第1の型を作製し、従来法と同じ超精密旋盤によるダイヤモンド切削で10 μ m削り落として規定寸法に仕上げ、第2の型を形成した。この時要した時間は、マスター型製作に2時間、加熱プレス成形に1時間、ダイヤモンド切削加工に4時間で、合計7時間であった。加工効率としては、本発明の金型の方が、約5倍良いことがわかった。金属ガラスの硬度は、Hv576であった。

【0085】

（実施例2）

直径5mmの回折溝に対応する突起を有する非球面の光学成形面を成形する金型として、従来の無電界ニッケルメッキ100 μ mを施した金型ブランクと、 $Zr_{55}Cu_{30}Al_{10}Ni_5$ 系金属ガラスを窒素雰囲気中でニアネットシェイ

ブ成形した第1の型とで、超精密旋盤による光学成形面の切削加工を行った。ダイヤモンド工具は、刃先先端の半径が $0.5\mu\text{m}$ の剣先バイトを用いた。突起間隔は最小で $9\mu\text{m}$ 、突起数は28本であった。刃先が非常に微小で鋭利なので、切削負荷によって折損するのを防止するために、どちらも切削条件は、切り込み量 $2\mu\text{m}$ 、工具送り速度 $0.1\text{mm}/\text{min}$ とした。このため、光学成形面を1回切削するのに必要な時間はどちらも約30分かかった。従来の金型では、厚い無電界ニッケルメッキにより光学面表面の凹凸が $20\mu\text{m}$ 程度発生するので、削り落とす量としては前述したように $50\mu\text{m}$ 程度必要となる。そのため、光学成形面の切削時間の合計は13時間を要した。一方、本発明のニアネットシェイブの第1の金型は、光学成形面の形状精度を $10\mu\text{m}$ 以下にできるので、その切削加工時間合計は4時間であった。回折溝に対応する突起を有する光学成形面の加工効率は、本発明による金型の方が3倍以上高かった。金属ガラスの硬度は、 $H_v 560$ であった。

【0086】

(実施例3)

石英バルクであるマスター型に、超精密旋盤研削砥石により直接 4.5mm の非球面の母光学面を創成加工した。非球面形状はあらかじめ金属ガラス $\text{Pd}_{53}\text{Cu}_{28}\text{Ni}_{10}\text{P}_9$ の収縮率を 0.3% に見込んだ。レジストをスピコートし、電界を形成できるように表面にクロムをコートして導体化した。電子ビームにより最小ピッチ $3\mu\text{m}$ 、段差量 $0.8\mu\text{m}$ 、溝数250本の回折溝をドーズ量を調整しながらレジストを露光した。これを現像し、プラズマCVDにより炭化弗素ガス 2mTorr 、RFパワー 500W の条件で3時間ドライエッチングし、段差 $0.6\mu\text{m}$ のブレード状の回折溝を非球面の母光学面に形成しマスター型を得た。このマスター型に外周部を成形する円筒をセットし、金属ガラス $\text{Pd}_{40}\text{Ni}_{10}\text{Cu}_{30}\text{P}_{20}$ を空气中で加熱軟化して室温雰囲気です押し成形し第1の型を得た。母光学面の成形転写性は、 $100\mu\text{m}$ 以下で、本来稜線となる回折溝の山の部分の曲率半径は、SEMで観察したところ 50nm 以下であった。また、回折溝の谷の部分も一部石英のカケと思われる部分はあるものの、曲率半径 50nm 以下の精

度で金属ガラスの成形面に転写していた。以上のように、溝ピッチが狭く、ダイヤモンド工具で切削しては非常に効率が悪く、また、工具刃先を鋭く加工するのに限界があるため谷形状が不正確になり、そのため成形された光学素子の回折効率が低下するような場合においても、本発明によれば、十分な回折効率を確保できる正確な溝形状を光学面に有する光学素子用金型を得ることができる。

【 0 0 8 7 】

(実施例 4)

金属ガラス $Zr_{55}Cu_{30}Al_{10}Ni_5$ を、窒素雰囲気中でニアネットシェイプ成形により直径 5 mm、長さ 35 mm の第 1 の型に製作し、超精密旋盤によるダイヤモンド切削で非球面の光学成形面を創成した。この光学成形面上にレジストをスピコートにより厚み $1.2 \mu m$ 塗布した。レーザービーム描画装置により、回折溝パターンを照射量を調整しながら露光した。レジストを現像して、最小ピッチ $5 \mu m$ 、段差 $0.8 \mu m$ 、溝数 130 本のブレード型の回折溝に対応する突起を形成した。これに、 3.0×10^{-4} Torr の Ar 雰囲気下で、400 V に加速したイオンビームを光学面の光軸方向から 15 分間照射して、ドライエッチングし第 2 の型を得た。金属ガラス光学面に、段差 $1.5 \mu m$ のブレード状の回折溝に対応する突起が形成できた。

【 0 0 8 8 】

(実施例 5)

図 6 は、金属ガラス $Pd_{40}Ni_{10}Cu_{30}P_{20}$ を平面形状にダイヤモンド切削して、原子間力顕微鏡 (AFM) で観察した顕微鏡写真である。切削条件は、工具の刃先 $R0.5 mm$ 、主軸回転速度 $900 rpm$ 、工具送り速度 $0.4 mm/min$ 、切り込み量 2 ミクロンであった。この条件での理論表面粗さは、 $Rz 0.05 nm$ である。切削平面の表面粗さは、 $Rtm 3.83 nm$ 、 $Ra 0.61 nm$ であり、図のようにカエリやむしれもなく非常に平滑な面であった。ほぼ同条件で切削したダイヤモンド切削用アルミ合金 (S3M) の表面粗さは、 $Rtm 4.9 nm$ 、 $Ra 0.80 nm$ であり、被削性が良いと言われている Al 合金よりも、金属ガラスの切削面の方が格段に良かった。

【 0 0 8 9 】

【発明の効果】

本発明によると、切削性に優れ、寸法精度を高めることができ、しかも所望の光学面の形状を転写形成可能な光学素子成形金型、もしくは微細形状を転写形成可能な光学素子成形金型、それを用いて形成される光学素子及びマスター型を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

第 1 の実施の形態の光学素子用金型の製作工程を示す図である。

【図 2】

第 1 の型 1 0 を機械加工する状態を示す図である。

【図 3】

光学素子であるレンズを形成するための金型を示す断面図である。

【図 4】

第 2 の実施の形態の光学素子用金型の製作工程を示す図である。

【図 5】

光学素子用金型により形成されるレンズの光学面を拡大して示す一部断面斜視図である。

【図 6】

金属ガラス $\text{Pd}_{40}\text{Ni}_{10}\text{Cu}_{30}\text{P}_{20}$ を平面形状にダイヤモンド切削して、原子間力顕微鏡 (AFM) で観察した顕微鏡写真である。

【符号の説明】

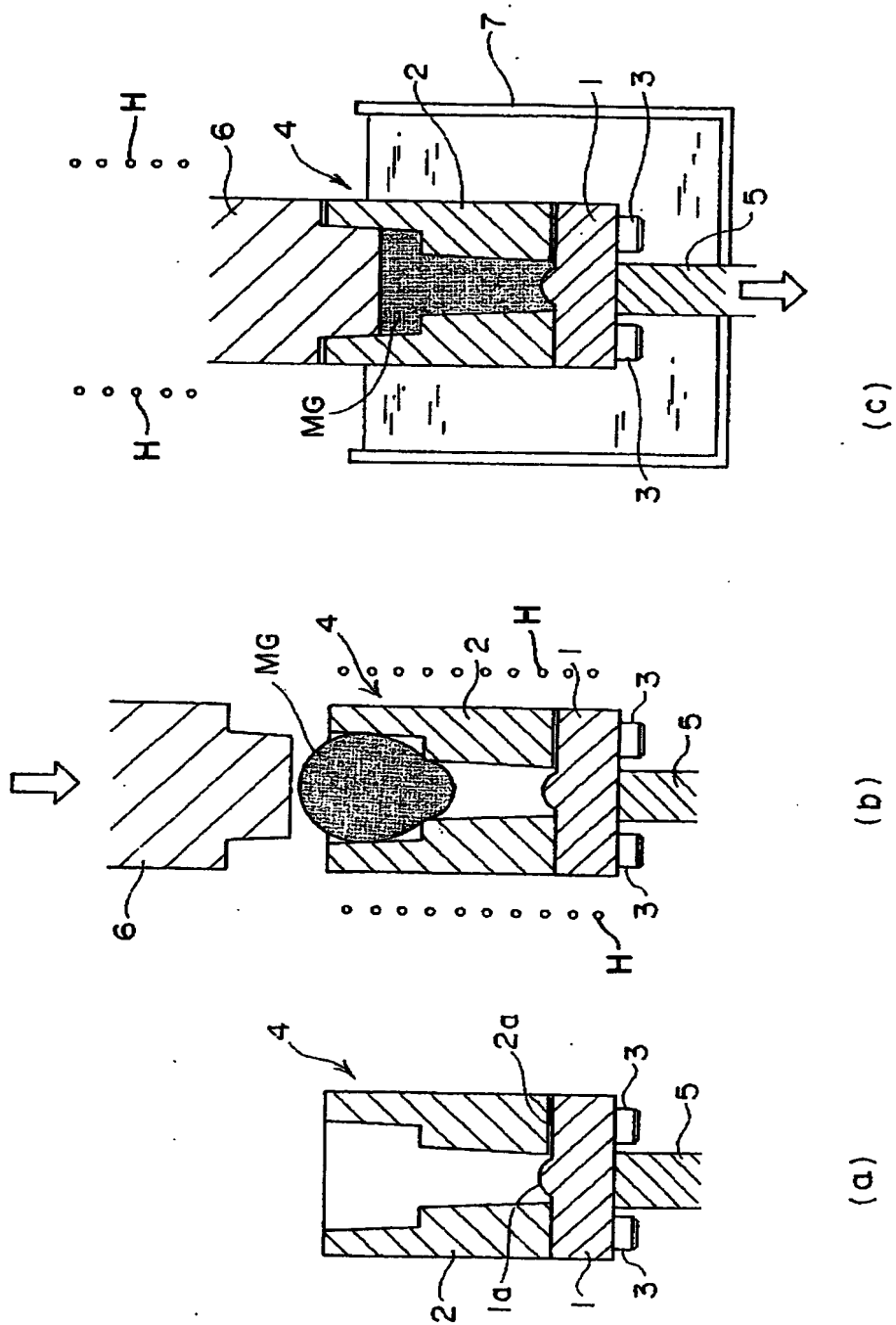
- 1 マスター型材
- 2 ブランク型
- 4 マスター型
- 5 支柱
- 6 プランジャー
- 7 容器
- 1 0 第 1 の型
- 1 0' 第 2 の型 (光学素子用金型)

特2001-054182

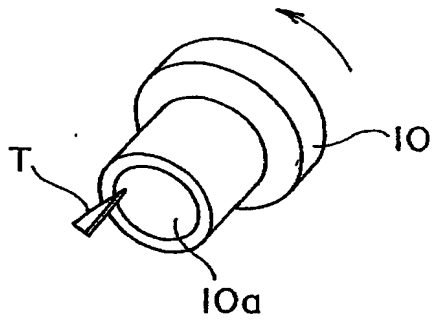
【書類名】

図面

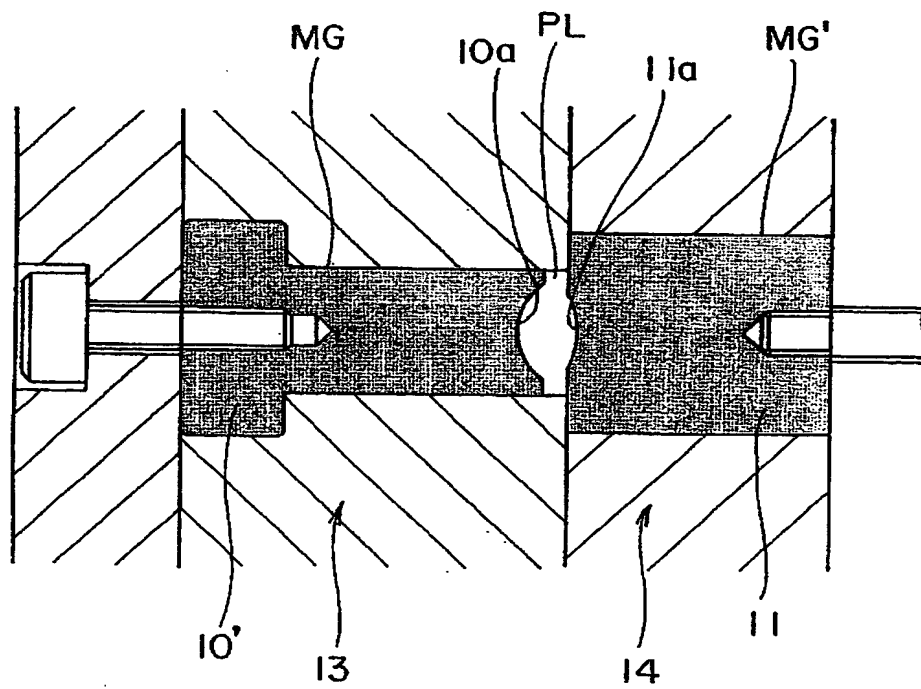
【図1】



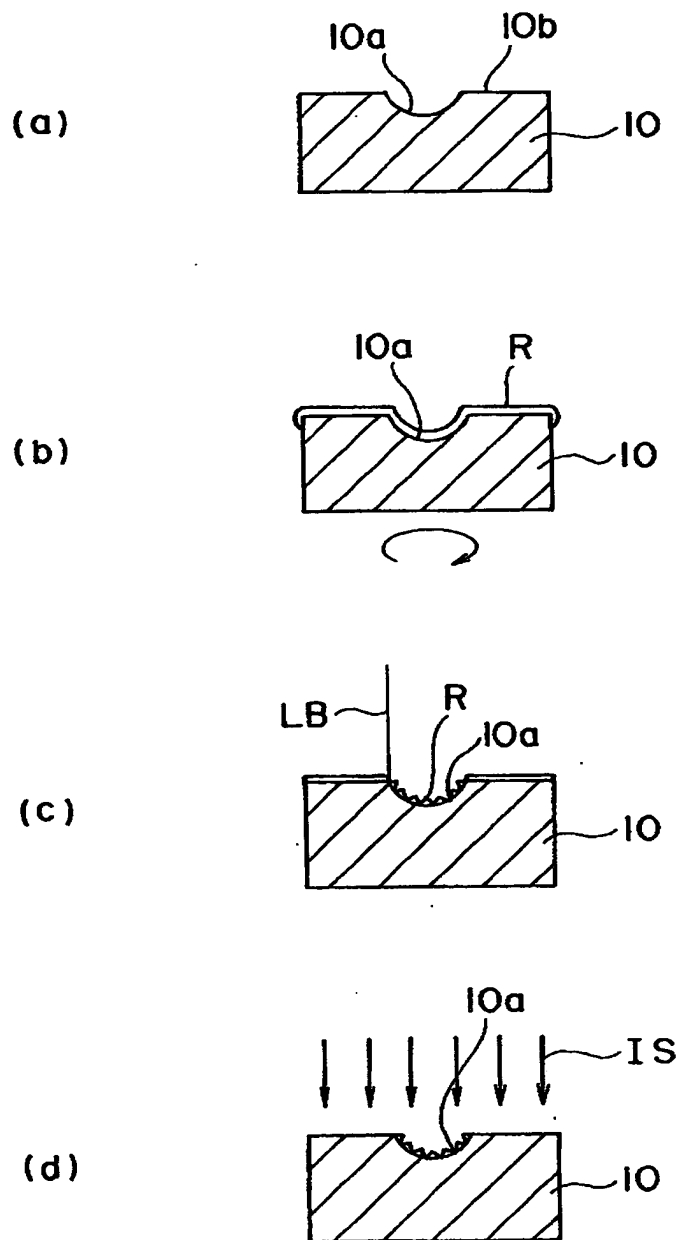
【図2】



【図3】

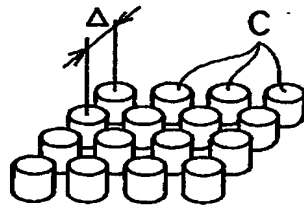


【図4】

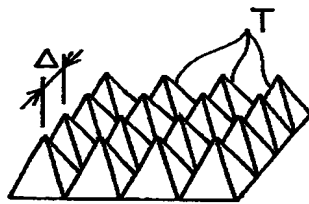


【図 5】

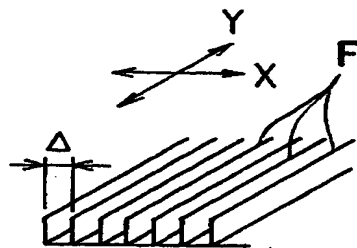
(a)



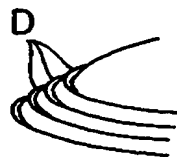
(b)



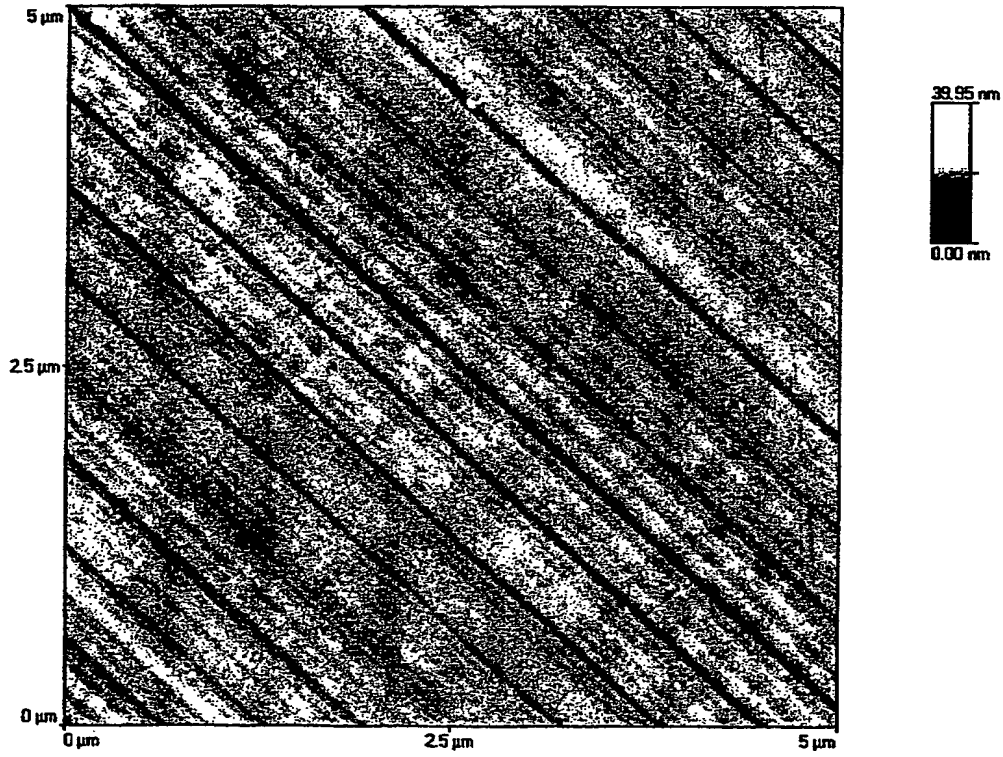
(c)



(d)



【図 6】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】

切削性に優れ、寸法精度を高めることができ、しかも所望の光学面の形状を転写形成可能な光学素子成形金型、微細形状を転写形成可能な光学素子成形金型、それを用いて形成される光学素子及びマスター型を提供する。

【解決手段】

過冷却液体域を有するアモルファス状合金MGを成形することによって形成された第1の型10に対し、光学成形面10aを削る加工を施すことによって第2の型10'を形成し、第2の型10'における光学成形面10aは、レンズの光学面もしくは寸法基準面を成形するために用いられるので、アモルファス状合金の被削性が極めて良好であることから、レンズの光学面もしくは寸法基準面に対応する金型の成形面を精度良く仕上げることができ、しかも工具の寿命を延長させることができる。

【選択図】 図2

認定・付加情報

特許出願の番号	特願2001-054182
受付番号	50100282423
書類名	特許願
担当官	第一担当上席 0090
作成日	平成13年 3月 1日

<認定情報・付加情報>

【提出日】	平成13年 2月28日
-------	-------------

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000001270]

1. 変更年月日 1990年 8月14日
[変更理由] 新規登録
住 所 東京都新宿区西新宿1丁目26番2号
氏 名 コニカ株式会社